

HERCULES NIL纳米压印推荐产品

发布日期：2025-09-23 | 阅读量：20

它为晶圆级光学元件开发、原型设计和制造提供了一种独特的方法，可以方便地接触最新研发技术与材料。晶圆级纳米压印光刻和透镜注塑成型技术确保在如3D感应的应用中使用小尺寸的高分辨率光学传感器供应链合作推动晶圆级光学元件应用要在下一代光学传感器的大众化市场中推广晶圆级生产，先进的粘合剂与抗蚀材料发挥着不可取代的作用。开发先进的光学材料，需要充分地研究化学、机械与光学特性，以及已被证实的大规模生产[HVM]的可扩展性。拥有在NIL图形压印和抗蚀工艺方面的材料兼容性，以及自动化模制和脱模的专业知识，才能在已验证的大规模生产中，以最小的形状因子达到晶圆级光学元件的比较好性能。材料供应商与加工设备制造商之间的密切合作，促成了工艺流程的研发与改善，确保晶圆级光学元件的高质量和制造的可靠性[EVG和DELO的合作将支持双方改善工艺流程与产品，并增强双方的专业技能，从而适应当前与未来市场的要求。双方的合作提供了成熟的材料与专业的工艺技术，并将加快新产品设计与原型制造的速度，为双方的客户保驾护航]“NILPhotonics解决方案支援中心的独特之处是：它解决了行业内部需要用更短时间研发产品的需求，同时保障比较高的保密性[SmartNIL 非常适合对具有复杂纳米结构微流控芯片进行高精度图案化，用在下一代药物研究和医学诊断设备生产[HERCULES NIL纳米压印推荐产品

EVG7200

全自动SmartNIL紫外光纳米压印系统



岱美仪器技术服务（上海）有限公司

键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

HERCULES®NIL特征：全自动UV-NIL压印和低力剥离最多300毫米的基材完全模块化的平台，具有多达八个可交换过程模块（压印和预处理）200毫米/300毫米桥接工具能力全区域烙印覆盖批量生产最小40nm或更小的结构支持各种结构尺寸和形状，包括3D适用于高地形（粗糙）表面*分辨率取决于过程和模板HERCULES®NIL技术数据：晶圆直径（基板尺寸）：100至200毫米/200和300毫米解析度[≤40nm]分辨率取决于模板和工艺）支持流程[SmartNIL®曝光源：大功率LED

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺) >400mW/cm²对准: ≤±3微米自动分离: 支持的前处理: 提供所有预处理模块迷你环境和气候控制: 可选的工作印章制作: 支持的吉林纳米压印供应商家EVG620 NT支持多种标准光刻工艺, 例如真空, 软, 硬和接近曝光模式, 以及背面对准选项。

EVG610 紫外光纳米压印系统



岱美仪器技术服务(上海)有限公司

键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVGROUP®|产品/纳米压印光刻解决方案纳米压印光刻的介绍EVGroup是纳米压印光刻NIL的市场领袖设备供应商EVG开拓了这种非常规光刻技术多年, 掌握了NIL并已在不断增长的基板尺寸上实现了批量生产EVG的专有SmartNIL技术通过多年的研究, 开发和现场经验进行了优化, 以解决常规光刻无法满足的纳米图案要求SmartNIL可提供低至40nm的出色保形压印结果。岱美作为EVG在中国区的代理商, 欢迎各位联系我们, 探讨纳米压印光刻的相关知识。我们愿意与您共同进步。

EVG®6200NT特征: 顶部和底部对准能力高精度对准台自动楔形补偿序列电动和程序控制的曝光间隙支持最新的UV-LED技术最小化系统占地面积和设施要求分步流程指导远程技术支持多用户概念(无限数量的用户帐户和程序, 可分配的访问权限, 不同的用户界面语言)敏捷处理和转换工具台式或带防震花岗岩台的单机版EVG®6200NT附加功能: 键对准红外对准智能NIL®μ接触印刷技术数据晶圆直径(基板尺寸)标准光刻: 75至200mm柔软的UV-NIL75至200毫米SmartNIL®最多至150mm解析度≤40nm分辨率取决于模板和工艺)支持流程: 软UV-NILSmartNIL®曝光源: 汞光源或紫外线LED光源对准: 软NIL≤±0.5μmSmartNIL®≤±3微米自动分离: 柔紫外线NIL不支持SmartNIL®支持工作印章制作: 柔软的UV-NIL外部SmartNIL®支持HERCULES®NIL是完全集成的纳米压印光刻解决方案, 可实现300 mm的大批量生产。

EVG7200 LA Large-Area SmartNIL 紫外光纳米压印系统



岱美仪器技术服务（上海）有限公司
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

HERCULES®NIL完全模块化和集成SmartNIL®UV-NIL系统达300毫米结合EVG的SmartNIL一个完全模块化平台®技术支持AR/VR 3D传感器，光子和生物技术生产应用EVG的HERCULESNIL300mm是一个完全集成的跟踪系统，将清洁，抗蚀剂涂层和烘烤预处理步骤与EVG专有的SmartNIL大面积纳米压印光刻NIL工艺结合在一个平台上，用于直径最大为300mm的晶圆。它是第一个基于EVG的全模块化设备平台和可交换模块的NIL系统，可为客户提供最大的自由度来配置他们的系统，以最好地满足其生产需求，包括200mm和300mm晶圆的桥接功能EVG开拓了这种非常规光刻技术，拥有多年技术，掌握了NIL并已在不断增长的基板尺寸上实现了批量生产EVG6200NT纳米压印

EVG620 NT是因其灵活性和可靠性而闻名的，因为它以最小的占位面积提供了最新的掩模对准技术HERCULES NIL纳米压印推荐产品

SmartNIL是行业领先的NIL技术，可对小于40nm*的极小特征进行图案化，并可以对各种结构尺寸和形状进行图案化SmartNIL与多用途软光刻技术相结合，可实现无人可比的吞吐量，并具有显著的拥有成本优势，同时保留了可扩展性和易于维护的操作EVG的SmartNIL兑现了纳米压印的长期前景，即纳米压印是一种用于大规模制造微米级和纳米级结构的低成本，大批量替代光刻技术。注：*分辨率取决于过程和模板如果需要详细的信息，请联系我们岱美仪器技术服务有限公司HERCULES NIL纳米压印推荐产品

岱美仪器技术服务（上海）有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的仪器仪表中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来岱美仪器技术服务供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！